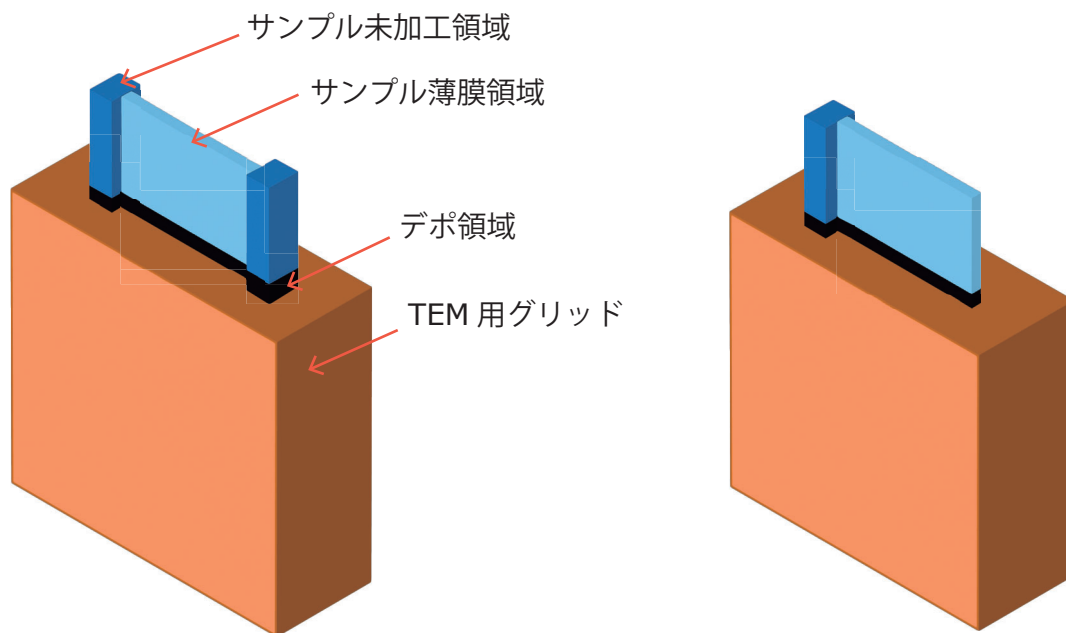


磁性体の TEM 用 FIB サンプル作成の注意点

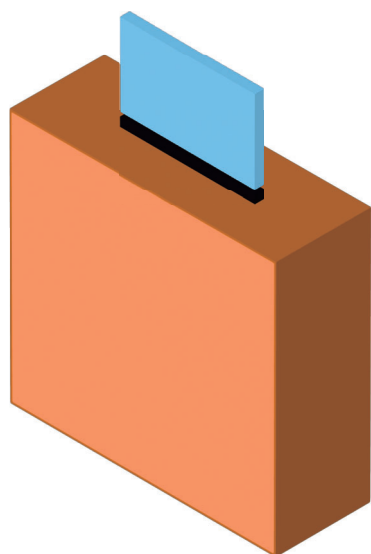
- FIB 加工した小さなサンプルでも、電顕内では磁力で変形します。
- 薄膜領域の変形・破壊を防ぐため下図のように支柱となる未加工領域を残してください。

OK



- サンプルとグリッドの接地面が全てデポで固定されていること。
- 未加工領域を残すこと。未加工領域は右図のように片側だけでも可。

NG



サンプルとグリッドの接地面が全てデポで固定されていても、支柱としてのサンプル未加工領域がなく、薄膜領域を自立させる形態は、磁性材料では控えてください。